

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.LGS N.33 DEL 14 MARZO 2013  
MODIFICATO DALL'ART.18 DEL D.LGS N.97 DEL 25 MAGGIO 2016 COME INTEGRATO  
DALL'ART.1 C.145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160, DELLE TRACCE D'ESAME  
STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE DI SEGUITO  
INDICATA NELLA RIUNIONE IN DATA 12/01/2024  
TRACCE DELLE PROVE D'ESAME**

**BANDO N. 400.8 ISM PZ PNRR**

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del *"Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato"*, per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di **Ricercatore III livello**, presso l'Istituto di Struttura della Materia (ISM) - Sede secondaria di Tito Scalo (PZ)

*Tematica: Sviluppo di materiali a film sottile (deposizione fisica e/o chimica da fase vapore), di superfici nanostrutturate mediante tecniche laser ultraveloci e progettazione dei relativi dispositivi*

**Busta n. 1**

1. Il candidato esponga un aspetto della sua attività di ricerca passata inerente alla tematica del bando concorsuale.
2. Il candidato descriva una tecnica per la deposizione di materiali a film sottile.
3. Il candidato legga e traduca pag. 238 del libro Harsha: *Principles of Physical Vapor Deposition of Thin Films*.

**Busta n. 2**

1. Il candidato descriva come la propria esperienza di ricerca possa contribuire allo sviluppo delle attività relative alla tematica del bando concorsuale.
2. Il candidato descriva la tecnica per la nanostrutturazione di superfici mediante irraggiamento laser.
3. Il candidato legga e traduca pag. 259 del libro Harsha: *Principles of Physical Vapor Deposition of Thin Films*.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Stefano Orlando